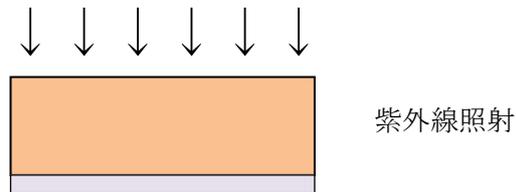


※課題番号 : F-12-KT-0100  
※支援課題名 (日本語) : 修飾方法の検討と評価  
※Program Title (in English) : Study and evaluation of modification method  
※利用者名 (日本語) : 野田雄一郎  
※Username (in English) : Yuichiro Noda  
※所属名 (日本語) : アークレイ株式会社 研究開発部  
※Affiliation (in English) : ARKRAY, Inc., Research and Develop division

※概要 (Summary) :

ガラス基板上にフォトレジストをコーティングする事により、表面の修飾が多様になる。その修飾方法の検討を行い、形成された表面の評価を行う。



※実験 (Experimental) :

ガラス基板の洗浄 (有機溶媒中で超音波洗浄後、乾燥して、ピラニア溶液に浸漬し、超純水で洗浄後乾燥) その後、ホトレジスト (SU-8) を塗布し、紫外線を照射し基板に固定した。



図2 プロセスフロー

※結果と考察 (Results and Discussion) :

評価実験に使用できるコーティング面が作製できたので、表面にさまざまな機能性、例えば親水性とするためにシランカップリング剤による親水化、またプラズマ照射による親水化、また界面活性剤による親水化を行い、種々の方法により形成された表面特有の効果を検討する。

※その他・特記事項 (Others) :

なし

共同研究者等 (Coauthor) :

小寺 秀俊 教授 (京都大学)

論文・学会発表

(Publication/Presentation) : なし

関連特許 (Patent) : なし



図1 基板に固定されたレジスト

